

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第7区分

【発行日】平成18年2月2日(2006.2.2)

【公開番号】特開2005-263336(P2005-263336A)

【公開日】平成17年9月29日(2005.9.29)

【年通号数】公開・登録公報2005-038

【出願番号】特願2004-74212(P2004-74212)

【国際特許分類】

B 6 5 G	49/06	(2006.01)
B 0 5 C	5/02	(2006.01)
B 0 5 C	13/02	(2006.01)
G 0 3 F	7/16	(2006.01)
H 0 1 L	21/677	(2006.01)
H 0 1 L	21/027	(2006.01)

【F I】

B 6 5 G	49/06	Z
B 0 5 C	5/02	
B 0 5 C	13/02	
G 0 3 F	7/16	5 0 1
H 0 1 L	21/68	A
H 0 1 L	21/30	5 6 2

【手続補正書】

【提出日】平成17年12月12日(2005.12.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項17

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項17】

前記塗布処理部は、

水平面において基板搬送方向に直交する方向に伸び、帯状に塗布液を吐出するスリット状の塗布液吐出口を有する塗布液供給ノズルと、

前記塗布液供給ノズルに少なくとも洗浄処理を施すノズル洗浄ユニットと、

前記塗布液供給ノズルを、前記基板搬送機構によって搬送される基板に塗布液を供給する位置および前記ノズル洗浄ユニットにアクセスさせるノズル移動機構と、を具備することを特徴とする請求項6から請求項16のいずれか1項に記載の塗布膜形成装置。